

29.02.2000

01 -03- 2000

KOLSTER OY AB

Patenttitsto Teknopolis Kolster Oy

Teknologiantie 4

90570 Oulu

Patenttihakemus nro: 19992092
Luokka: G01J / OPS
Hakija: Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Asiamies: Patenttitsto Teknopolis Kolster Oy
Asiamiehen viite: T299047FI

Määräpäivä: 29.08.2000

Patenttihakemuksen numero ja luokka on mainittava kirjelmässänne PRH:lle

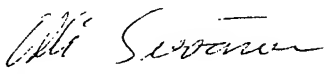
Patentoinnin edellytyksenä on, että keksintö on uusi ja eroaa olennaisesti ennestään tunnetusta tekniikasta (patenttilaki 2 §). Suoritetussa uutuustutkimuksessa on löytynyt julkaisuja, joiden perusteella itsenäiset vaatimukset 1 ja 13 eivät ole esitetyssä muodossaan hyväksyttävissä.

Tutkimuksessa on löytynyt seuraava patentoitavuuden kannalta merkittävänä pidettävä julkaisu: Julkaisussa US-A-5631735 (G01J3/04, Minolta Co.) on kuvattu spektrometri, joka on hakemuksessa esitettyjen itsenäisten vaatimusten 1 ja 13 mukainen. Valon eri aallonpituuksia moduloidaan eri taajuuksilla ja eri aallonpituudet erotetaan yksittäisen ilmaisimen signaalista Fourier-analyysin avulla (sar. 2, rivi 50 ja sar. 3, rivi 25).

Seuraavissa tekniikan tasoa kuvaavissa julkaisuissa esiintyvät ratkaisut eroavat hakemuksessa esiintyvistä 1. ja 13. vaatimuksesta siten, että modulaattorilta tuleva säteily kerätään ilmaisimelle jollakin muulla kuin diffraktiivisella elementillä. Julkaisussa WO-A-8504261 (G02F1/01, Bruker analytische messtechnik GmbH) on kuvattu optinen moduloiva komponentti ja sitä käyttävä spektrometri. Spektrometrissä on yksi diffraktiivinen elementti. Modulointiin käytetään Hadamard-multipleksausta. Julkaisussa US-A-4448529 (G01J3/28, Erwin-Sick GmbH) on kuvattu spektrometri, jossa on kuvaavia komponentteja, yksi diffraktiivinen elementti, yksi detektori ja modulaattorina toimiva pyörivä kiekko. Julkaisussa EP-A-0548830 (G01J3/28, Texas Instruments inc.) on kuvattu SLM spektrometri, joka perustuu kuvaaviin komponentteihin, prismaan, spatiaaliseen modulaattoriin ja yhteen ilmaisimeen. Spektrometrissa modulaattoria käytetään kuitenkin vain ilmaisimelle ohjattavan aallonpituuskaistan valintaan.

Mikäli hakemuksen käsittelyä halutaan jatkaa, hakijaa pyydetään toimittamaan uudet patenttivaatimukset, joissa on otettu huomioon tutkimuksessa esille tullut tekniikan taso. Itsenäinen patenttivaatimus tulee laatia siten, että vaatimuksen johdannossa esitetään keksinnöstä ne seikat, jotka edustavat tekniikan tasoa, ja tunnusmerkkiosassa määritellään se, mikä keksinnössä on uutta ja omalaatuista (patenttiasetus 14 §, patenttimääräykset 10 §). Patenttivaatimuksia muokattaessa on pidettävä mielessä, että niitä ei saa muuttaa siten, että ne tulevat sisältämään sellaista, mikä ei ilmene hakemuksen perusasiakirjasta.

Tutkijainsinööri
Puhelin:


Olli-Pekka Sievänen
(09) 69395438

Liite: kopiot viitejulkaisuista ja tutkimusraportista.

Lausumanne huomautusten johdosta on annettava viimeistään yllämainittuna määräpäivänä. Jollette ole antanut lausumanne virastoon viimeistään mainittuna määräpäivänä tai ryhtynyt toimenpiteisiin tässä välipäätöksessä esitettyjen puutteellisuuksien korjaamiseksi, jätetään hakemus sillensä (patenttilain 15 §). Sillensä jätetty hakemus otetaan uudelleen käsiteltäväksi, jos Te neljän kuukauden kuluessa määräpäivästä annatte lausumanne tai ryhdytte toimenpiteisiin esitettyjen puutteellisuuksien korjaamiseksi ja samassa ajassa suoritate vahvistetun maksun, 320 mk hakemuksen ottamisesta uudelleen käsiteltäväksi. Jos lausumanne on annettu virastoon oikeassa ajassa, mutta esitettyjä puutteellisuuksia ei ole siten korjattu, että hakemus voitaisiin hyväksyä, se hylätään, mikäli virastolla ei ole aihetta antaa Teille uutta välipäätöstä (patenttilain 16 §). Uusi keksinnön selitys, siihen tehdyt lisäykset ja uudet patenttivaatimukset on aina jätettävä kahtena kappaleena ja tällöin on otettava huomioon patenttiasetuksen 19 §.

Postiosoite: PL 1160
00101 Helsinki

Katuosoite: Arkadiankatu 6 A
00100 Helsinki

Puhelin: (09) 6939500
Telefax: (09) 69395328

Pankki: Leona
800015-47908


PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Patentti- ja innovaatiolinja

TUTKIMUSRAPORTTI

PATENTTIHAKEMUS NRO	LUOKITUS
992092	G01J 3/28

TUTKITTU AINEISTO
Patenttijulkaisukokoelma (FI, SE, NO, DK, DE, CH, EP, WO, GB, US), tutkitut luokat G01J3 (FI) G01J3/28 (FI, SE, NO, DK)
Tiedonhaut ja muu aineisto EPODOC, WPI

VIITEJULKAISUT		
Kategoria*)	Julkaisun tunnistetiedot	Koskee vaatimuksia
X	US-A-5631735, G01J3/04, Minolta Co.	1,13
A	WO-A-8504261, G02F1/01, Bruker analytische messtechnik GmbH	1,13
A	US-A-4448529, G01J3/28, Erwin-Sick GmbH	1,13
A	EP-A-0548830, G01J3/28, Texas Instruments inc.	1,13
*) X Patentoitavuuden kannalta merkittävä julkaisu yksinään tarkasteltuna Y Patentoitavuuden kannalta merkittävä julkaisu, kun otetaan huomioon tämä ja yksi tai useampi samaan kategoriaan kuuluva julkaisu A Yleistä tekniikan tasoa edustava julkaisu, ei kuitenkaan patentoitavuuden este		
Päiväys 28.2.2000	Tutkija  Olli-Pekka Sievänen	